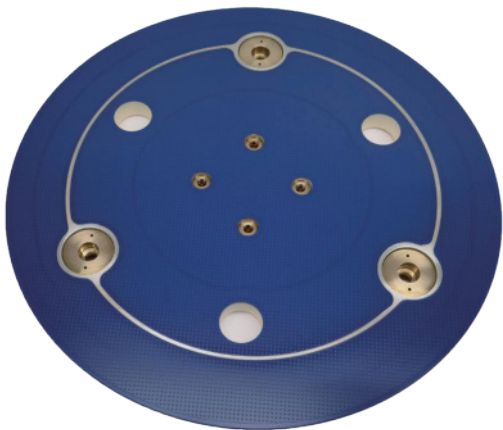




主要特点

- 库伦型吸盘或梯度力吸盘
- 支持双电极、多电极、叉指电极等设计
- 适用于 10^{-5} Pa及以下超高真空环境
- 静电吸附力大
- 吸附面全局面型精度高
- 吸附面表面图形可定制
- 适用于无磁环境
- 吸附对象包括晶圆, 蓝宝石、玻璃等介电材料

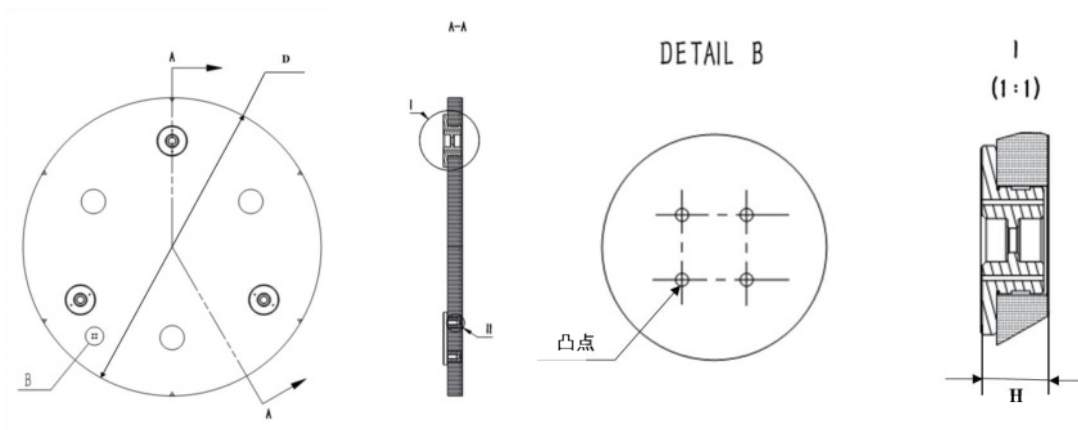
性能简介

静电吸盘(E-Chuck)是半导体工艺中硅片等衬底的夹持工具。E-Chuck以静电吸附为基本原理在施加外部高压后, 通过静电吸盘产生的库伦力或者梯度力来固定硅片等衬底的。

主要应用

- 晶圆量测: EBI, CD-SEM, Review-SEM
- 晶圆制造
- 薄膜沉积 (CVD、PVD等)

机械尺寸图



通用外形尺寸, 单位:mm

技术参数

	6inch E-Chuck	8inch E-Chuck	12inch E-Chuck	单位
原理类型/Electrostatic type	库伦型或梯度力	库伦型或梯度力	库伦型或梯度力	
电极类型/Electrode type	双电极或叉指电极	双电极或叉指电极	双电极或叉指电极	
精度/Accuracy				
全局平面度/Global flatness	≤3	≤3	≤3	μm
平行度/Parallelism	<30	<30	<30	μm
电气性能/Electrical properties				
标准吸附电压/Standard clamping voltage	1000	1000	1000	V
漏电流/Leakage current	<5	<5	<5	nA
性能参数/Performance parameter				
吸附力/Clamping force	≥8 (库伦型)	≥12 (库伦型)	≥30 (库伦型)	N
外观尺寸/Dimensions				
直径/Diameter	144	194	294	mm
厚度/Thickness	12.6	12.6	12.6	mm

*电极数量、平面度指标、外形尺寸和相关结构均可定制化设计